Static beam position monitor for a small ion storage ring S-LSR

Shinji Fujimoto^{1,A)}, Toshiyuki Shirai^{A)}, Akira Noda^{A)}, Hiromu Tongu^{A)}, Takeshi Takeuchi^{B)}, Koji Noda^{C)}

^{A)} Institute for Chemical Research, Kyoto University

Gokasho, Uji-shi, Kyoto, 611-0011 JAPAN

^{B)} Accelerator Engineering. Co. Ltd.

4-9-1, Anagawa, Inage-ku, Chiba-shi, 263-8555 JAPAN

^{C)} National Institute of Radiological Sciences

4-9-1, Anagawa, Inage-ku, Chiba-shi, 263-8555 JAPAN

Abstract

The static beam position monitors for a small ion storage ring S-LSR are being developed now. The monitors are installed at the chamber for a bending magnet because of the limited available space. The monitor is composed of four electrodes whose shape is a right triangle and dimension is $100[mm] \times 200[mm]$. The shape of the monitor aperture is octagon, and the distance between upper electrodes and lower electrodes is $46 \pm 0.3[mm]$. The position information of the monitors is calibrated with a test chamber. Two methods for position identification are proposed. One is Difference over Sum method, another is Log Ratio method. The linearity about $\pm 50[mm]$ was realized by the latter signal identification method. This region is the full length of the monitor electrode.

S-LSR 静電ビームポジションモニター

1 . Introduction

現在、京都大学化学研究所先端ビームナノ科学 センターにおいて小型重イオン蓄積リングS-LSRが 建設中である。S-LSRは周長約22.6[m]、6回対称の リングで蓄積イオン種はプロトン 7[MeV]、¹²C⁶⁺ [2MeV/u]、²⁴Mg⁺ [35keV]であり、ビーム冷却とし て電子ビーム冷却とレーザー冷却を行う予定であ る。ビーム冷却を行うに当たって電子ビームや冷 却レーザーとイオンビームを高い位置精度でオー バーラップさせることが重要である。また、蓄積 リング中で安定にビームを周回させるにはイオン ビームのCODを正しく測定しなければならない。 これらの要求を満たすビームモニターが静電ビー ムポジションモニターである。静電ビームポジ ションモニターは多数の蓄積リングで用いられて いるが、その理由は

)構造が簡単である

) 0.5[mm]程度の位置分解能を持つ

である。)ビーム軌道をトラッキングするため にリング中に多数設置する必要があり、その点電 極とフィードスルーからなる構造の静電ビームポ ジションモニターはシンプルである。)レー ザー冷却を行う際、レーザー径は1[mm]程度である から上記の分解能がないとイオンビームとレー ザーをオーバーラップさせることが難しい。

今回は以上の要求に沿う静電ビームポジション モニターを設計した。

2.1 デザインコンセプト

先に述べたようにS-LSRは非常にコンパクトなイオン蓄積リングであり、静電ビームモニターを12台(各Bending Magnetの両端に2台ずつ)設置するにはモニター固有のスペースをとることは出来ない。そのためBending Magnetの真空チェンバー(B-チェンバー)の四重極電磁石が取り付けられる部分のフランジに片持ち構造で設置することにし、



図1: ビームモニター設置場所 B-チェンバーのフランジ(四重極電磁石のある場 所)に設置する。

モニター自体は四重極電磁石の磁場を乱さないた めに全てSUS316L材を用いた。また、B-チェンバー の構造上、モニターの位置較正はB-チェンバーに 取り付けて行うことが出来ないため、チェンバー

^{2.}モニターデザイン

¹ E-mail: fujimoto@kyticr.kuicr.kyoto-u.ac.jp

外で較正を行った後でも取り付けが容易に出来、 モニターの各電極間の位置関係が保たれるように 箱型のモニターにした。モニターのデザインを図1 に示す。重量を減らすためにモニターのグラウン ド面は中抜きにして、薄いSUS材を取り付けること にした。



ビーム軸垂直方向から見た図。A部のプレートで Alignmentおよび固定をする。

モニター電極は幅100[mm]、奥行き200[mm]の直 角三角形を上下2枚ずつ計4枚からなる。上下電極 間距離は46±0.3[mm]である。Vertical Positionの測 定には上側電極と下側電極との信号を比較し、 Horizontal Positionには左右の電極信号を比較する。 信号の取り出しはセラマシール社製SMAフィード スルーを用いた。軸材は非磁性体インコネルXであ る。

モニターのAlignmentはモニター取り付け部にあ る複数個の押しネジ、引きネジ、さらにモニター 前部にある左右移動用の押しネジを使って行う。 このネジはモニター固定用としても用いる。

2.2 信号レベル

SMAフィードスルーを出た信号はNF Corporation 製の前置増幅器SA-220F5(PA220)で46[dB]増幅され る。期待される信号レベルは以下の式によって与 えられる。[1][2]

$$I(t) = \frac{qN}{\sqrt{2\pi\sigma}} \exp\left(\frac{-t^2}{2\sigma^2}\right)$$
$$V_{out} \cong G \frac{\phi}{2\pi} \frac{1}{C} \frac{L}{\beta c} \frac{2qN}{T_0} \exp\left(-\frac{\omega_0^2 \sigma^2}{2}\right)$$

蓄積イオン種の中でもっとも信号レベルが小さい ものは²⁴Mg⁺で、それに対する信号レベルは十分測 定可能な ~10[mV]である。

- 3.モニター位置較正テスト
- 3.1 較正テストセットアップ

モニターの位置較正テストを以下の図3のような セットアップで行った。Signal Generator からプロ トンや¹²C⁶⁺のRevolution Frequencyに近い1[MHz]の 信号をモニター内に図3のように張ったワイヤーに 流 す 。 PA220 で 増 幅 さ れ た 信 号 を Agilent Technologies製 Spectrum analyzer 4395Aを使って強 度を測定する。



図3:位置較正テストセットアップ

Signal Generatorからの信号(1[MHz]、-20[dBm])をワイヤーに流し、各電極からの信号をPA220にて増幅、Spectrum Analyzer で 各増幅器からの信号の強度を測定する。

3.2 信号処理

信号処理方法は2通りある。

-) Difference over Sum
-) Log Ratio

)、)はそれぞれ以下の式(1)、(2)によってポ ジションを決める。 X,Y はそれぞれHorizontal、 Vertical方向のポジションで、 $K_x, K_y, K_x', K_{y'}$ は測定系による定数、A,B,C,D, α は各電極から の信号および電極の位置を表す角度(位置関係は 図4参照)である。

$$\begin{split} \mathbf{X} &= \mathbf{K}_{\mathbf{X}} \Big[\mathrm{Log} \Big(\begin{array}{c} \mathbf{B}_{D} \Big) - \mathrm{Log} \Big(\begin{array}{c} \mathbf{A}_{C} \Big) \Big] \mathrm{cos} \, \alpha \\ \mathbf{Y} &= \mathbf{K}_{\mathbf{Y}} \Big[\mathrm{Log} \Big(\begin{array}{c} \mathbf{B}_{D} \Big) + \mathrm{Log} \Big(\begin{array}{c} \mathbf{A}_{C} \Big) \Big] \mathrm{sin} \, \alpha \end{split} \tag{1}$$

$$X = K_{x}' \frac{(B+C)-(A+D)}{A+B+C+D}$$

Y = K_{y}' \frac{(A+B)-(C+D)}{A+B+C+D} (2)



図4:電極の位置関係 ビームは紙面表から裏、A,B,C,Dは反時計回り αはHorizontal方向からの角度である。

これら2通りの方法で位置を同定し、プロットしたものが下図5である。)、)のそれぞれの方法について後者が広範囲で線形性を実現していることがわかる。



図5:Horizontal方向のワイヤー較正の結果

Vertical 方向のポジションは固定(Mechanical Center)Horizontal方向に5[mm]ステップでワイヤーを 移動させた結果。白丸が)の、黒丸が)の信号 処理方法の結果である。黒丸の方が広範囲でLinearity を実現していることがわかる。グラフ中の縦線が電 極幅である。

次の図6はVertical方向のポジションを5[mm]ステッ プで変化させ、各Verticalポジションに対してワイ ヤーをHorizontal方向に移動させた結果である。各 グループ(-10[mm],-5[mm],0[mm],5[mm],10[mm])に 対してVertical方向の位置は変わらないから、 Horizontal 方向のワイヤーの移動に対して直線が現 れるのが望ましいが電極幅程度になるとやはり直 線から外れてしまうことがわかる。



図6:Vertical信号変化の様子

下から-10[mm]、-5[mm]、0[mm]、5[mm]、10[mm]であ る。モニター電極幅 ± 50[mm]を越えたあたりから急激に 歪みが大きくなることがわかる。なお、中心のずれはワ イヤーやモニターのAlignmentミスではなく、PA220の個 性差である。

なおElectrical CenterとMechanical Centerとのずれが 約2[mm]あるが、これはNF Corporation製前置増幅 器の個性差であることがわかっており、各モニ ターに個別の前置増幅器を割り当てて位置較正を するようにしている。

ACKNOWLEDGMENT

本研究は放射線医学総合研究所、先進小型加速器 開発プロジェクトの一環として行われました。

REFERENCES

- R.E.Shafer."Beam Position Monitoring". In Proc. of The Physics of Particle Accelerators, No.249 in AIP Conf. Proc., pp. 601-636, 1992.
- [2] T.Watanabe. et al. Nucl. Instr. and Meth. A 381 (1996) pp. 194-208